

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of

Yoichiro NUMASAWA et al.

Serial No. NEW

Attn: APPLICATION BRANCH

Filed August 22, 2003

Attorney Docket No. 2003-1164A

METHOD FOR FORMING AN OXYGEN-OR NITROGEN-TERMINATED SILICON NANOCRYSTALLINE STRUCTURE AND AN OXYGEN- OR NITROGEN-TERMINATED SILICON NANOCRYSTALLINE STRUCTURE FORMED BY THE METHOD:

THE COMMISSIONER IS AUTHORIZED TO CHARGE ANY DEFICIENCY IN THE FEE FOR THIS PAPER TO DEPOSIT ACCOUNT NO. 23-0975.

CLAIM OF PRIORITY UNDER 35 U.S.C. § 119

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Applicants in the above-entitled application hereby claim the date of priority under the International Convention of Japanese Patent Application No. 2002-243342, filed August 23, 2002, as acknowledged in the Declaration of this application.

A certified copy of said Japanese Patent Application is submitted herewith.

Respectfully submitted,

Yoichiro NUMASAWA et al.

Bv

Michael R. Davis

Registration No. 25,134

Attorney for Applicants

MRD/pth Washington, D.C. 20006-1021 Telephone (202) 721-8200 Facsimile (202) 721-8250 August 22, 2003

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

2002年 8月23日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-243342

ST.10/C]:

[JP2002-243342]

出 願 人 pplicant(s):

アネルバ株式会社

2003年 6月16日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】

特許願

【整理番号】

3648P2002

【提出日】

平成14年 8月23日

【あて先】

特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】

C09K 11/00

【発明者】

【住所又は居所】

東京都府中市四谷5丁目8番1号 アネルバ株式会社内

【氏名】

沼沢 陽一郎

【発明者】

【住所又は居所】

東京都府中市四谷5丁目8番1号 アネルバ株式会社内

【氏名】

村尾 幸信

【特許出願人】

【識別番号】

000227294

【氏名又は名称】 アネルバ株式会社

【代理人】

【識別番号】

100059281

【弁理士】

【氏名又は名称】

鈴木 正次

【電話番号】

03-3353-3407

【連絡先】

FAX 03-3359-8340

【選任した代理人】

【識別番号】

100108947

【弁理士】

【氏名又は名称】 涌井 謙一

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

011589

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1